科学研究費助成事業

平成 30 年 5月 30 日現在

研究成果報告書



交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 2,900,000円

研究成果の概要(和文):がん治療器で炭素イオンビームと陽子ビームを共用することを目指して、高強度の炭 素イオンビーム発生技術が確立しているレーザーイオン源で陽子ビームを発生する研究を行った。具体的には水 素を多量に吸収することのできる金属八イドライトを用いて陽子ビーム発生方法の確立を目指した。材料の選 定、水素の吸蔵、陽子ビームと母材金属イオンビームとの分離なども問題点を明らかにし、研究期間を通じて多 くの実験的により概ね全ての問題点を克服することができた。ジルコニウムハイドライトを用いて、加速実験を 行い、がん治療として十分な耐久性がある事を確認し、研究を終了した。

研究成果の概要(英文): For realize cancer therapy accelerator which could provide both carbon beam and proton beams, we have studied proton beam production using laser ion source. We had already established high brightness carbon beam production form laser ion source, however proton beam production needed further studies. We employed hydride metal targets. We have tested many material and laser irradiation condition to extract high purity proton beam from hydride metal plasma. Finally we successfully established intense proton beam from zirconium hydride target. We also tested robustness of the target and could measure material consumption rate. Based of the results from the basic experimental work, acceleration test was carried out at an existing user facility at Brookhaven National Laboratory. The performance of proton beam production was demonstrated and verified.

研究分野:加速器科学

キーワード: 陽子線 炭素線 レーザーイオン源 レーザーアブレーションプラズマ

1. 研究開始当初の背景

実用化されている粒子線がん治療施設で は、加速ビームの取り出しは「遅い取り出 し」と呼ばれる、数秒間に渡ってビームを 少量ずつ出し続ける方法が採用されている。 この方法では、加速器から取り出されるイ オンの速度は均一である。これに対して、 局所的にがんの分布領域にのみ影響を及ぼ すことが可能な走査型照射の実用化が迫っ ている。走査型照射とは、イオンビームを パルス状に細かく分散し、一つのパルスの イオンエネルギー分布と照射位置をパルス ごとに制御することによってがん領域を立 体的に塗りつぶす手法である。この手法を 実現するためには加速器からの高速イオン を短いパルスに分割し、各々のパルスに含 まれるイオンビームの速度を要求に合わせ て変化させなくてはならない。したがって、 加速器システムの最上流であるイオン源か ら一秒間に数十回の繰り返し周波数で、炭 素または陽子線を必要に応じてパルス by パルスで切り替えながら供給する必要が生 じる。現在実用化されているパルス炭素線 の発生方法の中で上記条件を満たす最適な 方法は、応募者の発明した Direct Plasma Injection Scheme (DPIS)であり、国内では 東芝、中国では近代物理学研究所 (IMP)、 米国では Best Medical International 社によ ってその実証実験が始まっている。しかし ながら、炭素線発生装置と同一のイオン源 から、高繰り返しで陽子線を供給する技術 は未だに確立していない。治療に際して炭 素イオンと陽子を同じ装置で使い分ける事 ができれば、より柔軟で効率の良い運用が 見込める。粒子線治療装置は建設費用が1 00億円とも言われる高価な装置であり、 複合的でより効率の良い運用がのぞまれる 事から、DPIS で陽子線を発生する方法の確 立が望まれていた。

2. 研究の目的

高速繰り返し運転を特徴とする次世代重 粒子線がん治療加速器にイオンビームを供 給する為に、効率の優れたレーザープラズ マによる陽子線発生方法を探る。加速器で 発生した高速イオンで、局所的に存在する がん細胞を効率的に殺傷するために、速い 繰り返し(一秒間に数十回程度)でイオン ビームを発生する方法が必要とされている。 更に同じ施設で炭素線と陽子線を同時に使 用する事も検討され始めた。このような既 存の技術では困難な要求を実現するために、 炭素線供給源として実用化の始まったレー ザーイオン源を応用した速い繰り返しの可 能な陽子線発生方法を探る。具体的には、 水素原子を多量に含有する金属ハイドライ ドを標的とし、照射パルス幅をナノ秒以下 に抑えたレーザーを用いて効率よく陽子線 を発生できることを検証する。治療装置と しての運用を考慮すると、実験室レベルで

所定の性能が確保される事にとどまらず、 稼働中の加速器システムに実装した性能試 験を行う所までを目標とした。

3. 研究の方法

粒子線がん治療装置はイオン源、線形加速 器、シンクロトロン、照射装置から構成さ れる。従来用いられてきた設計手法で炭素 線を加速する為には、陽子線用加速器より も大型且つ複雑な仕様が全ての構成装置に 要求される。これは、炭素線を発生できる イオン源の性能が限られていた事に起因し ている。例えば、広く用いられている Electron Cyclotron Resonance (ECR)型 イオン源では単位時間あたりの発生粒子数 に上限がある。発生粒子の電荷数も4価程 度(価数が低いと加速効率が劣る)であり、 ある程度高速化した後に薄膜を通過させて 電荷数を上げる必要があった。これらの問 題を解決できるのが DPIS である。 DPIS は レーザーイオン源と高周波四重極線形加速 器(RFO)を組み合わせた新しいイオン発生 方法であり、1ジュール程度の小型レーザ ーで 5x10¹⁰ 個以上の C⁶⁺イオンを発生・加 速できる。従来型の重粒子治療器に要求さ れる個数の約 50 倍の完全電離炭素イオン をシステムの最上流で発生できるようにな った。このように DPIS を採用することに よって炭素線加速器はダウンサイジングさ れ、陽子線加速器規模に近づくことができ るようになったが、期待される粒子線がん 治療器の高度化においては、炭素線と陽子 線を同じ装置から供給できるようにしなく てはならない。ところが、DPIS を用いて陽 子線を発生した例は、検証実験を含めて皆 無である。これは、純度の高い水素のレー ザープラズマを発生することが難しいため である。応募者は 2006 年に気体を冷凍機で 固体化してレーザー標的として用いる研究 を行った。比較的昇華温度の高い、アルゴ ンやネオンはイオン源に適した良好なプラ ズマ特性を得ることに成功したが、水素分 子は昇華温度が極めて低く(10K程度)、 イオン化を担うレーザー照射の熱負荷との 両立が難しい事が分かった。また、冷凍機 を用いる場合、炭素標的を同時にイオン源 内に設置することは、構造的に困難である。 そこで、本研究では、常温で水素を多量に 含む金属ハイドライドを陽子線発生用レー ザー標的として開発・検証した。

金属ハイドライドは母材の金属に対して 重量比で数%もの水素含有率を示すものが あるが、レーザー標的として克服すべき問 題点が二つある。

最初の問題は陽子線の純度である。金属 ハイドライドからレーザープラズマを生成 した場合、プラズマ中に母材である金属イ オンが存在することは避けられない。水素 のイオン化エネルギーは金属のそれよりも 若干大きいため、水素イオンの存在するプ

ラズマ温度領域では金属の多価イオンが生 成されることが予測された。医療用として 陽子線を利用するにはプラズマ発生後に不 要な金属イオンを分離しなくてはならない。 DPIS では発生したプラズマをそのまま初 段加速器に入射する必要があるため、金属 イオンとの分離はプラズマ中で達成される 必要である。この問題を克服するために、 本研究ではプラズマの発生メカニズムその ものを制御することに取り組んだ。プラズ マ中でのイオン化はプラズマ温度だけでは なく、プラズマの加熱時間も重要であり、 レーザーイオン源ではレーザー光の照射時 間がこれに対応する。そこで、本研究では プラズマ温度を支配する標的表面でのレー ザーパワー密度とレーザーのパルス幅の両 方を変化させ、金属の多価イオンが少ない プラズマを生成することを探った。更に、 水素イオンの膨張速度が低価数金属イオン のそれよりも速いので、発生ビームを時間 的に区切る(イオンパルスの初期部分を切 り出す)事によって陽子線のみを分離でき ると考えられた。

二つ目の問題点は、ハイドライドの機械 強度である。一般に市販されているハイド ライドは粉末状である。これは、バルクの 母材を加熱し水素雰囲気中でハイドライド 化するときに母材自体が脆性破壊を起こし てしまい、原型を留められない為である。 医療用レーザー標的としては粉末のハイド ライドでは十分なプラズマ生成面積を確保 することが難しい。そこで、長期間運用が 可能なターゲットの保持構造の研究を行っ た。

最終的にはブルックヘブン国立研究所で 実際に長期運用されているレーザーイオン 源に開発した照射条件とターゲットを組み 込み、ビーム加速実験を行い、研究の成果 を検証した。

4. 研究成果

<u>ハイドライドターゲットの開発</u> 陽子イオン生成に適した素材の探索を行 った。チタンハイドライト、マグネシウム ハイドライトなどについて基礎的なデータ を収集した。図1実験装置の概観を、図2 に製作したチタンハイドライトのターゲッ ト写真を示す。



図1プラズマ分析装置概観

チタンハイドライトは比較的良好な性能 を示した。得られたプラズマの電流波形を 図3に示す。ピークが2つに分かれて観測 され、分析の結果、最初のピークAが陽子 ビームである事を確認した。分析の結果を 図4に示す。





マグネシウムハイドライトとチタンハイ ドライトとの比較から同様に水素を多く含 有でき、真空中に放置した状態でも水素を 開放しない打材質の中から、質量数の更に 大きいジルコニウムハイドライトを使って 陽子発生の検証を更に進めた。ジルコニウ ムハイドの水素吸着中のプロセスを図5に 示す。以上の研究を経て、水素を時間的に 分離して生成可能なジルコニウムハイドラ イトのターゲットを完成した。



図5 水素雰囲気中で冷却中の金属ジル コニウム粉末

レーザー照射条件の探索

本研究期間中に複数のレーザーを用いて、 最適な照射条件を多角的に探った。使用し たレーザーは, 6ns 1064nm 850 mJ, 170 ps 1064 nm 300 mJ, 6ns 1064 nm 2.0 J の 3 台 である。



図 6 170ps 295 mJ 2.6E10 W/cm2 で得 られるチタンハイドライトプラズマ

一例として図6に比較的レーザーを強 く集光した条件でプラズマ温度が古典吸収 の範囲よりも短いレーザーパルスを適用し た分析結果を示す。水素イオンのピークは 高い電流強度が達成されているがチタンイ オンも価数の高いものが多く生成されてい るために時間的な分離が難しい状況である ことが分かる。最終的に運用の比較的簡単 な6nsのレーザーを用いて10E9W/cm2 付 近の照射条件で確実に陽子とジルコニウム イオンが分離でき、ターゲットへの攻撃性 も少ない事がわかった。これによって、長 期運転が可能で効率よく陽子ビームを発生 する方法を確立した。

加速実験

使用可能な実験装置の都合により、実証 実験はブルックヘブン研究所で通常からイ オンを実験施設に供給しているイオン源を 用いて行った。実験開始時にはRFQ線形 加速器を使用した実験を行う予定であった

が、実際にユーザーにビームを供給してい る加速器に実装することによって、耐久性 を含めた実用度を実証することができた。 イオン源の概観を図7に示す。このイオン 源はプラズマの膨張に使われるドリフト距 離が3.3mと長い事が特徴であり、DPIS に適用する場合はドリフト長が三分の一以 下になることから、ピークカレントは30 倍程度になる。したがって、実用に供され るビーム強度も数十ミリAが見込める事が 同時に実証された。得られた電流波形を図 8に示す。使用したターゲットを図9に示 す。数日間の加速実験でレーザー1ショッ ト当たりのターゲット消費量は1.5マイ クログラムであった。実験期間中電流強度 の極端な減少は観測されず、がん治療器と しては十分な耐久性があることが確認され た。





図9 ジルコニウムハイドライトターゲ ット

まとめ

ターゲット素材の探索、開発、レーザー 照射条件の検討を行い、陽子ビームを十分 な耐久性で時間構造的に分離できる陽子ビ ームを発生方法を開発した。研究結果を実 証するために、実際に運用されている加速 器にターゲットを装填し、良好な陽子ビー ムが長期間発生できることを実証すること ができた。

5. 主な発表論文等 (研究代表者、研究分担者及び連携研究者 には下線)

〔雑誌論文〕(計5件) ① Saito, Y. <u>Okamura, M</u>. Kanesue, T. Ikeda, S. Yoshida, M. Production of Proton Beam with ZrH2 Pellet Target, 査読有, AIP Conference Proceedings (2018) Accepted for publication.

 Saito, Y. <u>Okamura, M.</u> Kanesue, T. Ikeda, S. Yoshida, M. Investigation of Laser Ablation Plasma from Thin Graphite Target, 査読有, AIP Conference Proceedings (2018) Accepted for publication.

③ <u>Okamura, M.</u> Stifler, C., Palm, K., Steski, D., Ikeda, S., Kumaki, M., and Kanesue, T. Proton beam production by a laser ion source with hydride target. 査読有, Review of Scientific Instruments 87, 02A906 (2016).

④ Kanesue, T. Kumaki, M., Ikeda, S., and Okamura, M. Low charge state heavy ion production with sub-nanosecond laser, 査 読有, Review of Scientific Instruments 87, 02A916, (2016)

⑤ Okamura, M., Palm, K., Stifler, C., Steski, D., Ikeda, S., Kumaki, M., and Kanesue, T. Calcium and lithium ion production for laser ion source, 査読有, Review of Scientific Instruments 87, 02A901 (2016)

〔学会発表〕(計6件) ① Saito, Y. <u>Okamura, M.</u> Kanesue, T. Ikeda, S. Yoshida, M. Production of Proton Beam with ZrH2 Pellet Target, 17th International Conference on Ion Sources, Geneva, Oct. 15-20 (2017)

② Saito, Y. <u>Okamura, M.</u> Kanesue, T. Ikeda, S. Yoshida, M. Investigation of Laser Ablation Plasma from Thin Graphite Target, 17th

International Conference on Ion Sources, Geneva, Oct. 15-20 (2017)

Saito, Y. <u>Okamura, M.</u> Kanesue, T.
 Ikeda, S. Yoshida, M., Proton Beam
 Generation with Laser Ion Source using
 ZrH2 Target
 Particle Accelerator Society of Japan,
 Sapporo, Japan, Aug. 1-3 (2017)

④ <u>Okamura, M.</u>, Stifler, C., Palm, K., Steski, D., Ikeda, S., Kumaki, M., and Kanesue, T. Proton beam production by a laser ion source with hydride target. 16th International Conference on Ion Sources, New York City, Aug. 23-28 (2015)

(5) Kanesue, T. Kumaki, M., Ikeda, S., and Okamura, M. Low charge state heavy ion production with sub-nanosecond laser. 16th International Conference on Ion Sources, New York City, Aug. 23-28 (2015)

6 <u>Okamura, M.</u>, Palm, K., Stifler, C., Steski, D., Ikeda, S., Kumaki, M., and Kanesue, T. Calcium and lithium ion production for laser ion source. 16th International Conference on Ion Sources, New York City, Aug. 23-28 (2015)

6.研究組織
(1)研究代表者
岡村 昌宏 (OKAMURA MASAHIRO)
国立研究開発法人理化学研究所・仁科加速
器科学研究センター・客員研究員
研究者番号:80332245

(4)研究協力者
齋藤 嘉人 (SAITO YOSHITO)
国立大学法人総合研究大学院大学・大学院
生
Cayla Stifler
University of Wisconsin-Madison, Research
Assistant
Takeshi Kanesue,
Brookhaven National Laboratory, Physicist
Shunsuke Ikeda
Brookhaven National Laboraotory,
Assistant Physicist